PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

05-266428

(43) Date of publication of application: 15.10.1993

(51)Int.Cl.

5/31 G11B 5/40 G11B

(21)Application number: 03-142153

(71)Applicant: ALPS ELECTRIC CO LTD

(22)Date of filing:

13.06.1991

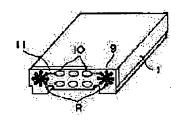
(72)Inventor: IBARAKI ATSUSHI

HASHIMOTO HIDEYUKI ISHIBASHI NAOCHIKA

(54) THIN FILM MAGNETIC HEAD

(57)Abstract:

PURPOSE: To efficiently radiate Joule's heat generated from head elements in a thin film magnetic head by electric conduction by forming a metallic pattern on a protective layer on the head elements. CONSTITUTION: A metallic pattern is formed on the surface of a protective layer on head elements 8 in a thin film magnetic head so as to cover the head elements 8. Since the metallic pattern is formed on the protective layer, heat generated from the head elements 8 can be efficiently radiated.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

20.06.1996

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

2703838

[Date of registration]

03.10.1997

[Number of appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-266428

(43)公開日 平成5年(1993)10月15日

(51)Int.Cl.⁵

識別記号 庁内整理番号

H 7247-5D

FΙ

技術表示箇所

G 1 1 B 5/31 5/40

審査請求 未請求 請求項の数1(全 4 頁)

(21)出顯番号	特顧平3-142153	(71)出願人 000010098
		アルプス電気株式会社
(22)出願日	平成3年(1991)6月13日	東京都大田区雪谷大塚町1番7号
		(72)発明者 茨木 淳
		東京都大田区雪谷大塚町1番7号 アルブ
		ス電気株式会社内
		(72)発明者 橋本 秀幸
		東京都大田区雪谷大塚町1番7号 アルブ
		ス電気株式会社内
		(72)発明者 石橋 直周
		東京都大田区雪谷大塚町1番7号 アルブ
		ス電気株式会社内
		(74)代理人 弁理士 志賀 正武 (外2名)

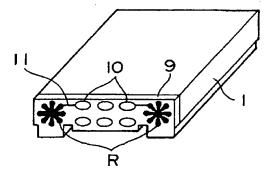
(54) 【発明の名称】 薄膜磁気ヘッド

(57)【要約】

【目的】 薄膜磁気ヘッドにおけるヘッドエレメント上 面の保護層に金属バターンを形成することで、通電によ ってヘッドエレメントから発生するジュール熱を効率良 く放熱することを目的とする。

【構成】 薄膜磁気ヘッドにおけるヘッドエレメント上 面の保護層表面にヘッドエレメントを覆うように金属バ ターンを形成する。

【効果】 保護層に金属パターンを形成することでヘッ ドエレメントから発生した熱を効率良く放散することが できる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板上に下部絶縁層、下部磁性層、ギャ ップ層、層間絶縁層、信号巻線、上部磁性層等を積層し たヘッドエレメントを備え、その上面に保護層が形成さ れてなる薄膜磁気ヘッドにおいて、前記保護層の表面に ヘッドエレメントを覆うように、金属パターンを形成し たことを特徴とする薄膜磁気ヘッド。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は薄膜磁気ヘッドに関する 10

[0002]

【従来の技術】磁気記録密度の向上に伴い、磁気ヘッド のトラック幅を小さくするために、あるいは多トラック 構成とするため薄膜構造を採用した磁気へッドの実用化 が進んでいる。

【0003】従来の薄膜磁気ヘッドの構成例を以下に説 明する。図4は、従来の薄膜磁気ヘッドの斜視図であ る。図5は、従来の薄膜磁気ヘッドの断面構造を示す図 である。図5に示す薄膜磁気ヘッドは基板(スライダ) 1の上に、下部絶縁層2を介して、下部磁性層3が形成 され、その上にギャップ層7が形成されている。そし て、ギャップ層7の上に、層間絶縁層5が形成され、層 間絶縁層5の内部に信号巻線4が形成されている。信号 巻線は4は、CuやAlの導電膜からなり、巻線抵抗を 下げるようにされている。さらに、この上に、上部コア となる上部磁性層6が形成されている。また、上部磁性 層6の上にA1,O,, SiO,等からなる厚さ、20~30 μmの保護層9が被着されている。なお、下部絶縁層2 とギャップ層7と層間絶縁層7と信号巻線4と上部磁性 30 層6とからヘッドエレメント8が形成されている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】図5で説明した薄膜磁 気ヘッドにおいて記録のための磁界の強さは、信号巻線 4の巻数と、流れる電流の積に比例するが、薄膜磁気へ ッドにおいては、巻数を多くとることが困難であり、電 流値を大きくせざるを得ない。電流値が大きくなると、 巻線の電気抵抗にもとずくジュール熱が発生することに なり、薄膜磁気ヘッドの寿命、読み出し時の熱雑音発生 などへの悪影響が考えられる。また、下部磁性層3や上 40 部磁性層6の磁気特性も温度上昇によって劣化するおそ れがある。従って、この発生する熱を放散させ磁気へッ ドの温度上昇を防止することが必要である。

【0005】しかも、保護層9としては、一般に真空蒸 着やスパッタによるSiO、あるいは、A1,O,層等が 用いられ、その熱伝導率は、0.003cal/cm·sec·℃程度で あって、熱の不良導体であり、保護層9は厚みも大き く、これによる熱絶縁のために磁気ヘッドの温度上昇が 回避されない問題があった。

として、保護層9の熱伝導率が悪いことがあり、熱の放 **散性に優れ、かつ膜形成が容易な保護層9が望まれてい**

[0007]

【課題を解決するための手段】以上に述べたSiO,、 Al,O,等からなる、従来の保護層の問題点を解決する 手段として本発明は、基板(スライダ)上に下部絶縁 層、下部磁性層、ギャップ層、層間絶縁層、信号巻線、 上部磁性層等を積層したヘッドエレメントを備え、その 上面に保護層が形成されてなる薄膜磁気ヘッドにおい て、前記保護層の表面にヘッドエレメントを覆うよう に、金属パターンを形成したものである。金属パターン の形状は、ヘッドエレメント表面からの熱放射に対する 反射をできるだけ少なくするように形成し、その厚さを 4~10μmとすることが好ましい。又、金属パターンを保 護層の表面に形成する方法としては、スパッタまたはメ ッキ等を用いる。ベタづけでは、ヘッドエレメント表面 からの熱放射に対し反射を起こし、蓄熱してしてまい放 熱効率を悪くし充分な効果が得られない。より効率良く ヘッドエレメントからの熱を放散させる方法として金属 パターンを黒色に着色する方法がある。

[0008]

【作用】本発明の薄膜磁気ヘッドを用いるならば、保護 層に熱伝導率の良い金属材料を用いた、金属パターンを 形成することで、通電によって発生するジュール熱をす みやかに放熱することが可能となり、この熱放散により 熱雑音を少なくし、ヘツドエレメントの寿命を改善する ととができる。

[0009]

【実施例】図1~図3に、本発明の実施例を示す。本発 明は、薄膜磁気ヘッドはもちろんのこと、薄膜構造でへ ッドエレメントを構成する磁気へッド全般に適用される ものである。尚、以下の実施例における薄膜磁気ヘッド において、前記従来例の薄膜磁気ヘッドと同一構成要素 については、同一符号を付している。

【0010】本実施例の薄膜磁気ヘッドは、基板(スラ イダ) 1の後部にヘッドエレメント8が形成されてい る。ヘッドエレメント8は、図2に示すように基板(ス ライダ) 1上に下部絶縁層2、下部磁性層3、ギャップ 層7、層間絶縁層5、信号巻線4上部磁性層6等を積層 した構造である。信号巻線4の材質としてはCu. A1 等が用いられる。下部絶縁層2としては、A1,O, S iOz等が、層間絶縁層5としては、ポリイミド、レジ スト、SiOz, Al,O,等が用いられる。下部磁性層 2と上部磁性層6としては、パーマロイ等のNi-Fe 系合金等が使用される。従って、ヘッドエレメント8上 面は、通常の構成では、上部磁性層6が現われる。との 上部磁性層6の上面に保護層9が形成されている。

【0011】保護層9の表面には、熱伝導率の高い金属 【0006】以上のことから、薄膜磁気ヘッドの問題点 50 材料からなる、金属バターンRが、形成されている。金 3

属パターンRの形状はヘッドエレメント8の表面からの * 熱放射に対する反射をできるだけ少なくするように形成する。例えば、図3に示すような中心部12と複数の腕部13と先端部14とからなるヒトデ型形状に形成し、その中心部12をヘッドエレメント8の最も蓄熱しやすい中央部分に対応するようにする。そして、ヘッドエレメント8の中央蓄熱部分から中心部12に、との熱をすみやかに伝熱させる。伝熱された熱は、中心部12から放射状に伸びる腕13によって各方向に放散し、さらにその腕部13の先端についている先端部14によって効 10率良く放熱させるようにする。また、との金属パターンRの厚さは熱の放散効率上、4~10μmとすることが好ましい。金属パターンRを形成する方法としては、スパッタまたはメッキなどを用いる。

【0012】とのように形成された金属パターンRをグランド端子10に、導伝層11によって電気的に接続する。金属パターンRとグランド端子10を接続することにより、アースされた金属パターンRがヘッドエレメント8を覆うので高周波のシールド効果が得られ、ヘッドエレメント8に対する外部誘導ノイズを遮蔽し、とのノ 20イズによる悪影響を防止するととができる。

【0013】 こうして、保護層9の表面に熱伝導率の高 い金属材料を用いた金属パターンRを形成することで、 通電によりヘッドエレメント8から発生するジュール熱 を保護層9から、すみやかに放熱することが可能とな り、ヘッドエレメント8の寿命を改善することができ る。さらに、放熱効率が上がれば、薄膜磁気ヘッドの記 録特性を上げるためにヘッドエレメント8に電流を多く 流すことが可能となり、再生時に起こる熱雑音の改善を することができる。ところで、金属パターンRを形成す 30 る場合、金属パターンRを金属箔から形成してこれを保 護層 9上に張り付けるような即ち、ベタ付けする手段を とることは好ましくない。このようにすると、金属パタ ーンRと保護層9との接着部分で畜熱されて放熱効率が 低下することになる。また、保護層9の内側のヘッドエ レメント8で生じた熱を金属パターンRで効率良く吸収 するために、金属パターンRを黒色に着色しても良い。*

* これにより、金属パターンRでもってより効率良くへッドエレメント8の熱を発散させることができる。

[0014]

【発明の効果】本発明によれば、ヘッドエレメント上面の保護層に熱伝導性の高い金属を材料とする金属バターンを形成することで、ヘッドエレメントで発生した熱をすみやかに放散させることができる。ゆえに、ヘッドエレメントの寿命を改善することができる。さらに、こうして放熱効率が上がればヘッドエレメントに電流を多く流すことが可能となり、再生時に起こる熱雑音の改善をすることができる。よって、高密度磁気記録用磁気ヘッドにとって極めて有用な効果が得られる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例で保護層上面に金属バターンを 付着した薄膜磁気ヘッドの斜視図である。

【図2】図1における薄膜磁気ヘッドの断面図である。 【図3】図1における金属パターンR部分の拡大図であ

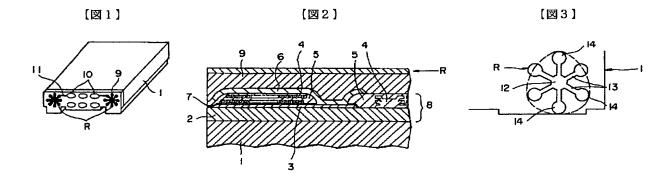
【図3】図1における金属パターンR部分の拡大図であ る。

【図4】従来の薄膜磁気ヘッドの一例を示す斜視図であ の る。

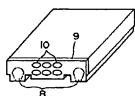
【図5】図4に示す従来の薄膜磁気へッドの断面図である。

【符号の説明】

- 1 基板
- 2 下部絶縁層
- 3 下部磁性層
- 4 信号巻線
- 5 層間絶縁層
- 6 上部磁性層
- 10 7 ギャップ層
 - 8 ヘッドエレメント
 - 9 保護層
 - 10 グランド端子
 - 11 導電層
 - 12 中心部
 - 13 腕部
 - 14 先端部







[図5]

